This Page Is Inserted by IFW Operations and is not a part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images may include (but are not limited to):

- BLACK BORDERS
- TEXT CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
- FADED TEXT
- ILLEGIBLE TEXT
- SKEWED/SLANTED IMAGES
- COLORED PHOTOS
- BLACK OR VERY BLACK AND WHITE DARK PHOTOS
- GRAY SCALE DOCUMENTS

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning documents will not correct images, please do not report the images to the Image Problem Mailbox.

PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

06-325637

(43) Date of publication of application: 25.11.1994

(51)Int.CI.

H01B 13/00

CO3C 17/25 5/14

(21)Application number: 05-113360

(71)Applicant: SUMITOMO METAL MINING CO LTD

TOHOKU KAKO KK

(22)Date of filing:

14.05.1993

(72)Inventor: YAMANAKA ATSUSHI

ORITA KEIICHI KOIZUMI KEIJU

(54) TRANSPARENT CONDUCTIVE COATING FILM FORMING APPLICATION LIQUID AND LOW REFLECTING TRANSPARENT CONDUCTIVE FILM

(57)Abstract:

PURPOSE: To provide an application liquid of low viscosity and excellent in conductivity and further to improve light transmissive and mechanical strength of a transparent conductive film using this application liquid by constituting it by containing an organic indium compound, organic tin and an organic solvent.

CONSTITUTION: An organic indium compound of selecting at least one kind of acetylacetone indium and indium octilate and organic tin of selecting at least one kind of acetylacetone tin and octyl acid tin are used in a transparent conductive film forming application liquid. As an organic solvent, an acetylacetone solution or the like with dissolved alkylphenol and/or alkenyl phenol is used by selecting at least one kind of liquid diluted by alcohol. In this way, an application liquid excellent in transparency with low viscosity and good wettability to a glass substrate is obtained. By using this application liquid, since a transparent conductive film excellent in mechanical strength with low reflection can be formed, the film can be effectively used in an electric field shield of a CRT or the like and electrostatic prevention.

LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

10.09.1999

[Date of sending the examiner's decision of

rejection]

[Kind of final disposal of application other than

the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

3338970

[Date of registration]

16.08.2002

[Number of appeal against examiner's decision

of rejection

[Date of requesting appeal against examiner's

decision of rejection]

[Date of extinction of right]

Copyright (C); 1998,2003 Japan Patent Office

(19)日本国特許庁(JP)

(12) 公開特許公報(A)

Fι

(11)特許出願公開番号

特開平6-325637

(43)公開日 平成6年(1994)11月25日

(51) Int.Cl.⁵

識別記号 庁内整理番号

技術表示箇所

HO1B 13/00

503 C 7244-5G

C 0 3 C 17/25

A 7003-4G

110 1 B 5/14

Α

審査請求 未請求 請求項の数3 OL (全 10 頁)

(21)出願番号

(22) 州願日

特願平5-113360

Mark to 110000

平成5年(1993)5月14日

(71)出頭人 000183303

住友金属鉱山株式会社

東京都港区新橋5丁月11番3号

(71)出蹟人 000221959

東北化工株式会社

東京都品川区西五反田7丁目9番4号

(72)発明者 山中 厚志

千葉県市川市南大野2-8-13 リネスハ

イツ206

(72)発明者 折出 桂一

東京都品川区西元反田7丁目9番4号 東

北化工株式会社内

(74)代理人 弁理士 菅野 中

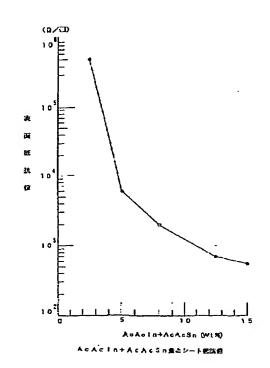
最終頁に続く

(54) 【発明の名称】 透明導電性被膜形成用塗布液及び低反射透明導電膜

(57)【要約】

【目的】 低粘度で面内バラッキが小さい低反射の透明 導電膜を得る。

【構成】 アセチルアセトンインジウムと、アセチルアセトン鍵とをアルキルフェノールを溶解したアセチルアセトン溶液に溶解した透明導電性被膜形成用途布液である。粘性が小さく、スピンコートによる展延性に優れ、コーティング液のなじみがよく、オーバーコートを施して低反射の透明導電膜の形成が可能である。



【特許請求の範囲】

【請求項1】 有機インジウム化合物と、有機錫と、有機溶剤とを含む透明導電性被膜形成用塗布液であって、有機インジウム化合物は、アセチルアセトンインジウム、オクチル酸インジウムの内の少なくとも1種類が選択されたものであり、

1

有機錫は、アセチルアセトン錫, オクチル酸錫の内の少なくとも1種類が選択されたものであり、

有機溶剤は、アルキルフェノール及び/又はアルケニルフェノールを溶解したアセチルアセトン溶液、アルキル 10フェノール及び/又はアルケニルフェノールを溶解したアセチルアセトン溶液をアルコールで希釈した液の少なくとも1種類が選択されたものであることを特徴とする透明導電性被膜形成用塗布液。

【請求項2】 ヒドロキシプロビルセルロースを含む透明導電性被膜形成用塗布液であって、

ヒドロキシプロビルセルロースは、有機溶剤中に含まれた全アルキルフェノール及び/又はアルケニルフェノール量の内の1.0~12.5重量%の等量を置換したものであることを特徴とする請求項1に記載の透明導電性 20 被膜形成用塗布液。

【請求項3】 透明導電性被膜とコーティング膜との積層からなる低反射透明導電膜であって、

透明導電性被膜は、請求項1又は2に記載の透明導電性 被膜形成用塗布液の塗布により基板上に形成された被膜 であり、

コーティング膜は、シリコンアルコキシドを含むコーティング液を前記透明導電性被膜上にオーバーコートしたものであることを特徴とする低反射透明導電膜。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【産業上の利用分野】本発明は、電界シールド用の透明 導電膜形成用塗布液、特にCRTなどのガラス面上に塗 布して透明な導電膜の形成に用いる透明導電性被膜形成 用塗布液及びとの塗布液を用いてガラス面上に形成した 低反射透明導電膜に関する。

[0002]

【従来の技術】ディスプレイ、テレビのブラウン管表面の静電気帯電防止膜の形成用インクとしては、従来より主としてATO(錫ーアンチモン系酸化物)系のゾルゲ 40ルインクが実用化されてきた。静電気対策用には表面抵抗値で10¹¹Ω/□程度が要求されるが、このレベルは、ATOで十分に対応ができるレベルである。

【0003】ところが、近年欧州を中心にCRTから発生する電磁界の人体に対する影響について関心が高まり、スウェーデンをはじめ一部の国では既にガイドラインができている。米国及びに本国内でも規制には至ってないが、対応策が検討されている状況にある。漏洩磁界は芸置的な工夫で解決されると言われているが、電界については対応が一様でない。

【0004】CRT表面の電界をシールドする方法として、CRTブラウン管ガラス表面にLTO膜を蒸着又はスパッター法で成膜したガラス、又はプラスチックパネルをはめ込む方式等があり、限定された分野向けには実用化されている。この方法は十分に低抵抗化できることから、性能的には満足できるが、製造コストが高いことから広く一般的に実用化されるには至っていない。

2

【0005】とのような背景から塗布により導電膜を形成する方法が検討されている。との方法は、例えば有機金属化合物の溶液を基板に塗布したのち、加熱焼成するととにより導電膜を形成するものである。塗布法によれば、大がかりな設備を必要とせず、大面積化や大量生産が容易である利点を有している。

【0006】特公昭57-138108号公報には、インジウム化合物、錫化合物及び溶剤を含み、溶剤としてアルコール類、セロソルブ類、カルビトール類、グリコール類が開示されている。

【0007】また、特公昭61-26679号公報には、アセチルアセトン基などを含む有機インジウム化合物、 [Y]、Sn [X]、で示される有機錫化合物及び有機溶剤を含み、有機溶剤としてメチルエチルケトン、酢酸エチル、ベンゼンが開示されている。

【0008】また、特開平4-255768号公報には、硝酸インジウム、有機錫化合物、ヘキシレングリコール並びに酢酸及び/又は無水酢酸を含有する塗布液が開示されている。

【0009】また、特開昭57-36714号公報には、無機インジウム化合物,配位能を有する有機化合物,錫化合物,セルロース類の如き粘性剤及び溶剤からなり、配位能を有する有機化合物としてカルボン酸類,カルボン酸エステル類,ヒドロキシ酸が開示されている。

【0010】また、特開昭57-212268号公報には、インジウム化合物、錫化合物、有機溶剤及びセルロース化合物からなるベースト状組成物が開示されている。

【0011】また、特公昭63-25448号公報には、インジウム化合物、抵抗値調整用としてスズ化合物、粘性剤としてニトロセルロースと溶剤としてセルソルブ、カルビトール、ベンジルアセテート、ジメチルフタレートを含む組成物が開示されている。

【0012】また、特公平2-20706号公報には、 トリアセトナートインジウム、ビスアセナルアセトナー ト錫、セルロース化合物、高沸点アルコール類を含む組 成物が開示されている。

【0013】また、特公昭63-19046号公報には、トリアセチルアセトナートインジウムなどのインジウム化合物、ジメチルスズアセトーブなどの有機錫錯体、粘性剤、有機溶剤からなるペーストに、モノアゾ系 有機化合物が加えられた組成物が開示されている。

[0014]

【発明が解決しようとする課題】透明導電膜形成用塗布 液は、要するに導電性微粒子の有機物,無機物を有機溶 剤に添加して得られたペーストである。導電膜の成膜 性、導電性、透明性、機械的強度は、選定された導電性 微粒子の種類, 性質, 粒径, 添加量, 有機溶剤の性質に よって左右され、導電性微粒子と、有機溶剤との相互作 用によって膜特性が決定されるため、その組合せの選定 は、トライアンドエラーの繰返しであったといえる。

3

【0015】また、塗布液の粘度は、有機溶剤中に含ま 10 れたセルロースの添加量によって増大するため、低粘度 が必要とされるスピンコートによる成膜に用いる塗布液 には、セルロースが添加されていない特公昭57-13 8108号, 特公昭61-26679号に記載された組 成物を用いるのが望ましい。このような組成物を用いる ことによって、スピンコート法により一応透明な導電性 薄膜を形成できるが、この組成物によって必ずしも十分 満足できる膜特性が保証されるわけではなく、改善の余 地は残されている。

した場合の問題点として、塗布液を塗布し、これを加熱 して基板上に焼付けたのみでは、導電膜の光沢のため、 光を反射し、画面が見づらいという問題がある。一般に は光沢をなくすため、低反射のオーバーコートを施す技 術があり、シリコンアルキシド液を含むコーティング液 (アルキルシリケートゾル液) のような低反射で高い光 透過性を有するコート液が知られているが、このような コーティング液は、導電性塗布液に対するなじみが悪 く、前記各塗布液により形成された膜上にアルキルシリ ケートゾル液をオーバーコートし、乾燥並びに焼成によ 30 って得られた膜は、面内でバラツキが生じて不均質とな り、あるいはスジムラが生じて実用に供しうるものでは ない。

【0017】本発明の目的は、低粘度で、導電性に優れ た透明導電性被膜形成用塗布液並びにこの液を用いて光 透過性、機械的強度に優れた低反射の透明導電膜を提供 するととにある。

[0018]

【課題を解決するための手段】上記目的を達成するた め、本発明による透明導電性被膜形成用塗布液において 40 は、有機インジウム化合物と、有機錫と、有機溶剤とを 含む透明導電性被膜形成用塗布液であって、有機インジ ウム化合物は、アセチルアセトンインジウム、オクチル 酸インジウムの内の少なくとも1種類が選択されたもの であり、有機錫は、アセチルアセトン錫、オクチル酸錫 の内の少なくとも1種類が選択されたものであり、有機 溶剤は、アルキルフェノール及び/又はアルケニルフェ ノールを溶解したアセチルアセトン溶液、アルキルフェ ノール及び/又はアルケニルフェノールを溶解したアセ

チルアセトン溶液をアルコールで希釈した液の少なくと も1種類が選択されたものである。

【0019】また、本発明による透明導電性被膜形成用 塗布液においては、ヒドロキシプロピルセルロースを含 む透明導電性被膜形成用塗布液であって、ヒドロキシブ ロピルセルロースは、有機溶剤中に含まれた全アルキル フェノール及び/又はアルケニルフェノール量の内の 1.0~12.5重量%の等量を置換したものである。 【0020】また、本発明による低反射透明導電膜にお いては、透明導電性被膜とコーティング膜との積層から なる低反射透明導電膜であって、透明導電性被膜は、前 記透明導電性被膜形成用塗布液の塗布により基板上に形 成された被膜であり、コーティング膜は、シリコンアル コキシドを含むコーティング液を前記透明導電性被膜上 にオーバーコートしたものである。

[0021]

【作用】本発明においては有機インジウムとして、イン ジウムアセチルアセトナート (AcAcln)、オクチ ル酸インジウム(Octln)、実施例では、商品名ナ 【0016】さらに透明な導電膜をガラス基板上に形成 20 ーセムインジウム(Metal Acetylacet onate, In28%, 日本化学産業(株)製), ホ ープ I n (I n 2 5 %, ホープ製薬 (株) 製), 有機錫 としてピスアセチルアセトナートジメチル錫(AcAc Sn), オクチル酸錫(Ос t Sn)、実施例では商品 名ナーセム錫(日本化学産業(株)製), ニッカオクチ ック錫(Stannous Octoate, Sn28 %, 日本化学産業(株)製)を使用した。

> 【0022】アルキルフェノールとしては、パラターシ ャリーブチルフェノール、オクチルフェノール、ノニル フェノールなど、アルケニルフェノールとしては、3ペ ンタデカデシルフェノールなどが使用できる。アルコー ル類としては、メチル、エチル、プロピル、プチルアル ーコルのほかにもシクロヘキサノールなどが使用でき る。勿論、エチルアルコールに上記のその他のアルコー ル類を適宜添加してもよい。

【0023】本発明の塗布液は、通常上記a)インジウ ム化合物, b) 錫化合物, c) アルキル及び/又はアル ケニルフェノール, d) アセチルアセトン溶液及び/又 はアセチルアセトンとアルコールの混液を含む透明な溶 液又は、アルキル及び/又はアルケニルフェノールの 1. 0~12. 5 w t %をヒドロキシプロビルセルロー スで置換した透明な溶液である。かかる溶液は、例えば これらの成分を常温~150℃の間に0.5~12時間 撹拌することにより得られる。上記製造条件によって得 られた溶液粘度の例を示せば表1のとおりである。表1 の成分配合はw t %を示している。以下の表においても 同じである。

[0024]

【表1】

4

AcAcIn	11.5		11. 5	5. 75
OctIn		11. 5		
OctSn	1. 0	1. 0	1. 0	0.50
バラターシャリー ブチルフェノール	12.5	12. 5	12.5	6. 25
アセチルアセトン	75.0	75. 0	37. 5	87. 50
エチルアルコール			37. 5	
粘度cps/25℃	2. 5	2. 5	2. 5	1. 8

【0025】本発明の塗布液は、スピンコート、スプレ ーコート、バーコート及びブレードコートにより成膜す るととができる。

【0026】本発明の塗布液は、ガラス基板との濡れ性 20 も申し分なく、使用されている溶剤が中沸点及び/ある いは中沸点と低沸点の混液であることから、塗布作業中 に適度に揮発し、揮発によって膜形成成分の基板への固 着とオーバーコートに対する耐性(粒の発生,帯状模様 の生成, 白化がない) が得られ、また残留溶剤によって レベリングを生じ、従って膜厚の面内バラツキが非常に 小さい導電膜が得られる。

[0027] a) AcAcIn (又はOctIn),

b) AcAcSn (又はOctSn), c) アルキル及 び/又はアルケニルフェノール, d) アセチルアセトン 30 及び/又はアセチルアセトンとエチルアルコール混液で 構成される本発明の塗布液は、塗布作業時の基板温度を 45~60℃に設定して行う。45℃未満では塗布液が 基板上ではじきの現象を呈し、60℃を越えると、蒸発 速度が早く、表面張力が大きくなって、膜厚が不均一に

【0028】基板温度を45~60℃に設定した場合、 塗布液中のAcAcIn(又はOctIn)+AcAc Sn (又はOctSn) が5wt%を越えると、アルキ ルシリケートゾル液をオーバーコートすることなく乾 燥、焼成して得られた膜には、亀裂が発生していた。反 対に、5 w t %未満であると塗布作業時にはじきを生じ た。しかし、5 w t %の塗布液によって得られた膜は、 はじきや亀裂などの不都合もなく、表面抵抗値に6ΚΩ /□が示された。

【0029】塗布液中のAcAcIn (又はOctI n) +AcAcSn (又はOctSn)が5wt%ない しそれ以上の塗布液を、45~60℃に設定された基板 上に塗布し、数分後にシリコンアルドキシドを含むコー ディング液をオーバーコートし、次いで乾燥、焼成して「50」意の組合せでは、表面抵抗値が、図1,図2の特性の間

得た膜は、亀裂などの不都合のない光透過性、機械的速 度に優れたものであった。

【0030】とれは導電層の焼成に伴う収縮をオーバー コート層が吸収することによるものと思われる。かくし て1層目の導電層は1nとSnの含有量が多いことから 導電性が良好な膜として形成される。

【0031】上記本発明の塗布液において、アルキル及 び/又はアルケニルフェノールの1.0~12.5wt %をヒドロキシプロビルセルローズで置き換えた塗布液 は、塗布作業時の基板温度が室温~60℃の間で均一に 塗布することができる。 ヒドロキシプロピルセルローズ の代替量が1.0 w t %未満では塗布時にはじきの現象 が、また12.5%を越えると、焼成膜にスジムラの不 都合が生じるととが分かった。

[0032]図1に、AcAcIn+AcAcSn=1 5wt% (In/Sn = 92/8), N = 92/8ブチルフェノール+ヒドロキシプロピルセルロース=1 5wt%(フェノール/セルロース=95/5)及びア セチルアセトン70 w t%で構成される塗布液を調整 し、とれをエチルアルコールで希釈してAcAcln+ AcAcSnが12. 5wt%, 8wt%, 5wt%及 び2.5 w t % とし、各々についてスピンコートにより 成膜、乾燥、焼成して得た膜のシート抵抗値を示した。 40 いずれの膜も亀裂など不都合のない、光透過性、機械的 強度に優れ、面内バラツキの非常に小さいものであっ

【0033】図2に、AcAcInの代りにOctIn を、AcAcSnの代りにOctSnを用いたほかは、 図1と全く同様の方法で行った結果を示した。 図2に明 らかなとおり、OctInとOctSnとの組合せによ るときには、AcAcIn、AcAcSnの組合せによ るものより、表面抵抗値が高い。したがって、AcAc In, ΛεΛεSη & Oct In, Oct Sη & Off.

に納まるものと考えられる。ヒドロキシブロビルセルロースを含まない塗布液を用いて成膜、乾燥、焼成して得た膜にコーティング液を塗布した二層の表面抵抗値についても、同程度の表面抵抗値を有しているものと考えられる。

[0034]

【実施例】以下実施例により本発明を詳細に説明する。 【0035】オーバーコートに使用するシリコンアルキシドを含むコーティング液は次のようにして調整した。 すなわち、5grのエチルシリケート40(多摩化学 (株)製)に1grの5%塩酸を加えよく振盤する。これを冷却して9grの水を加え良く撹拌しながら薄めた後、110grのエチルアルコールを加えて4wt%溶液に調整した。

【0036】(実施例1~3) 撹拌棒, 温度計と還流冷却管を付した3つ口フラスコ中に150g r のアセチルアセトンと25g r のハラターシャリーブチルフェノールを加え、120~135℃で0.5時間撹拌しながら溶解した。次いで23g r のΛ c Λ c I n と2g r のΛ*

* c A c S n を加え、同温度で3時間溶解した。冷時 1 μ mの濾紙を用いて濾過し、透明導電性被膜形成用塗布液 を調整した。

3

【0037】得られた塗布液の半分を分取してこれを実施例1の試料とし、残りの半分をエタノールで希釈してAcAcln+AcAcSnが8wt% (実施例2)及び5wt% (実施例3)の塗布液とした。150mm×200mm×9mmの青板硝子基板を50℃の熱風乾燥炉に20分間入れて加温した後、スピンナーにセットし、前記塗布液10grを150rpmの回転速度で2分間塗布、次いで4wt%のアルキルシリケートゾル液10grを1分間塗布した。120℃の熱風乾燥炉で10分間乾燥した後、焼成炉に入れ、常温~450℃まで1時間掛けて昇温し、450℃に達してから30分間焼成した。200℃以下で取り出して得られた膜の特性は、表2に示したとおりである。

【0038】 【表2】

2層構造焼成膜の特性

			実 施 例				
NP.			1		2	3	
光							
透	A	Acin	11,	5	7.4	4. 6	
過	A	e A c S n	1.	0	0.6	0.4	
率	パラターシャリー・		12.	5	8. 0	5. 0	
LT	ブラ	チルフェノール					
	アセチルアセトン		75.	0	48.0	30.0	
	エチルアルコール		0.	0	36.0	60.0	
墨				_			
価		光透過率%	83.	7	85.9	85. 9	
Н	符	(550 nm)					
		€価 %	0.	0	0.0	0. 0	
	性	(550nm)	•		ı		
		鉛筆硬度	>9	H	>9 H	>9Н	

青板硝子基板 I.T 85.9%

II 0.0%

【0039】(実施例4~6) A c A c S n の代りにO c t S n を用いたほかは実施例 1~3 と全く同様の材料

構成及び製造方法で行った結果を表3に示した。

40 [0040]

【装3】

2層構造焼成膜の特性

	実	施 6	म्
	4	5	6
AcAcīn	11.5	7. 4	4. 6
OctSn	1.0	0.6	0.4
パラターシャリープチルフェノール	12.5	8.0	5. 0
アセチルアセトン	75. 0	48.0	30.0
エチルアルコール	0.0	36.0	60.0
特 光透過率% (550nm)	83. 2	85. 9	85. 9
曇価 % (550nm)	0.0	0.0	0.0
性 鉛筆硬度	>9 H	>9 H	>9 H

青板研子基板 I.T 85.9%

*構成及び製造方法で行った結果を表4に示した。

II 0.0%

[0042]

【0041】(実施例7~9) AcAcInの代りにO

【表4】

c t 1 n を用いたほかは実施例1~3と全く同様の材料*20

2 層構道焼成膜の特性

	実	施 6	RĮ.
	7	8	9
Octin	11. 5	7. 4	4. 6
AcAcSn	1.0	0.6	0.4
バラターシャリープチルフェノール	12.5	8. 0	5. 0
アセチルアセトン	75. 0	48.0	30.0
エチルアルコール	0.0	36.0	
特 光透過率% (550 nm)	83. 2	85.9	85. 9
曇価 % (550nm)	0.0	0.0	0. 0
性 鉛筆硬度	>9н	>9H	>9 H

青板硝子基板 LT 85.9%

H 0.0%

たほかは実施例1~3と全く同様の材料構成及び製造方 法で行った結果を表うに示した。

【0043】(実施例10~12) AcAcInの代り

[0044]

にOctin, AcAcSnの代りにOctSnを用い 40 【表5】

2 層構造焼成膜の特性

	実 施 例			
	10	11	1 2	
Octln	11. 5	7. 4	1. 6	
AcAcSn	1. 0	0.6	0.4	
パラターシャリープチルフェノール	12.5	8.0	5. 0	
アセチルアセトン	75.0	18.0	30.0	
エチルアルコール	0.0	36.0	60.0	
特 光透過率% (550nm)	83. 2	85.9	85.9	
会価 % (550 nm)	0.0	0.0	0.0	
性 鉛筆硬度	>911	>911	>911	

青板硝子基板 I.T 85.9%

0.0%

【0045】(実施例13~22) 撹拌棒, 温度計及び ンとパラターシャリーブチルフェノールを120~13 5℃で0.5時間撹拌しながら溶解した。次いで計算量 のヒドロキシプロピルセルロースを徐々に加え、同温度 で1時間溶解した。AcAcln(又はOctln)を 23grとAcAcSn (又はOctSn)を2gr加米

*えて3時間損拌溶解した後、1 µmの濾紙を用いて濾過 し、透明導電性被膜形成用塗布液を調整した。得られた 塗布液を基板温度が室温 [20℃] である以外は実施例 還流冷却管を付した3つ□フラスコ中にアセチルアセト 20 1~3と全く同様の方法でスピンコートし、オーバーコ ートをせずにそのまま乾燥、焼成して得た膜の特性を表 6, 表7に示した。

> [0046] 【表6】

	実		施 例		
	i 3	14	1.5	16	17
AcAcIn	13.8	11.5	7.4	4.6	2. 3
AcAcSn	1.2	1.0	0.6	0.4	0.2
パラターシャリー プチルフェノール	14.2	11.8	7. 6	4.7	2.4
ヒドロキシブロ ビルセルロース	0.8	0.7	0.4	0.3	9. 1
アセチルアセトン	70.0	56.0	37.3	23, 3	11.7
エチルアルコール		19.0	46.7	66.7	83.3
表面抵抗值0/口	5,7×10 ²	6,5×10 ²	2,1×10 ³	6.0×10 ³	5.1×10 ⁵

基极温度 20℃ スピンコート

回転数 150rpm 回転時間 2 min

120°C×10min 乾 燥 桀 成 450°C×30min

[0047]

【表7】

14

	実		施	例	
	8 1	19	20	2 1	2 2
Octin	13.8	11.5	7, 4	4.6	2. 3
OctSn	1.2	1.0	0.6	0.4	0.2
パラターシャリー プチルフェノール	14.2	11.8	7.6	4.7	2. 4
ハイドロオキシプ ロピルセルロース	0.8	0, ?	C, 4	0.3	0. 1
アセチルアセトン	70.0	56.0	37.3	23, 3	11,7

1.4×10⁴

1.2×10⁴

スピンコート 基板温度 20℃ | 何転数 150rpm | 回転時間 2min | 乾 燥 120℃×10min | 焼 成 450℃×30min

 3.2×10^4

19, 0 46, 7 66, 7 83, 3

1.1×10⁵

【0048】(実施例23~26)撹拌棒, 温度計及び 還流冷却管を付した3つ□フラスコ中に150grのア セチルアセトンと25 [1-x]gr, ただし、xはヒ ドロキシプロビルセルロースの代替率で0.125, 0.08,0.05及び0.10のパラターシャリーブ チルフェノールを120~135℃で0.5時間撹拌し ながら溶解した。次いで計算量のヒドロキシプロビルセ ルロースを徐々に加え、同温度で1時間溶解した。Ac Ac1nを23grとAcAc2grを加えて3時間撹 30

表面抵抗値Ω/口

拌溶解した後、 $1 \mu m$ の濾紙を用いて濾過し、実施例 $2 3 \sim 26$ の透明導電性被膜形成用塗布液を調整した。得られた塗布液を基板温度が室温 $[20 \, ^{\circ}\! C]$ である以外は実施例 $1 \sim 3$ と全く同様の方法でスピンコート,オーバーコートし、そのまま乾燥,焼成して得た膜の特性を表8 に示した。

[0049]

【表8】

15

2層構造焼成膜の特性

		実	施	例
	2 3	2 4	2 5	2 6
A c A c I n A c A c S n パラターシャリー プチルフェノール ヒドロキシブロビル セルロース アセチルアセトン	11.5 1.0 10.9 1.6	11.5 1.0 11.5 1.0	11. 5 1. 0 11. 9 0. 6	11.5 1.0 12.375 0.125
特 光透過率% (550 nm)	83.6	84. 0	84. 6	84. 9
藝術% (550nm) 性 鉛等硬度	0. 0 9н	0. 0 9 H	0. 0 9H	0. 0 9H

青板硝子基板 LT 85.9%

H 0.0%

[0050]

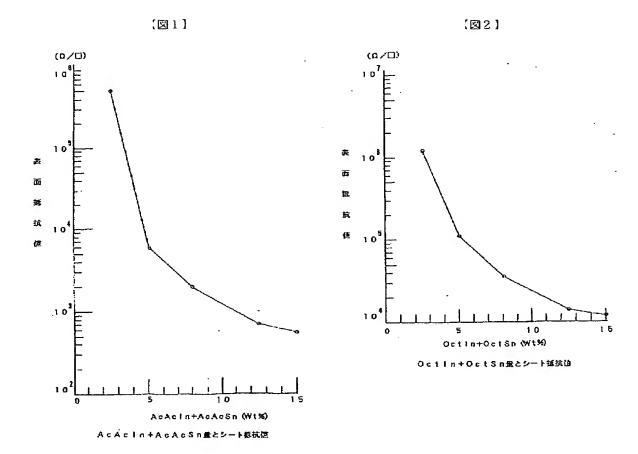
【発明の効果】以上のように本発明の透明導電性被膜形 成用塗布液によれば、透明性に優れ、粘性が低く、ガラ ス基板に対する濡れ性が良いため、スピンコート法、ス プレーコート, バーコート法を用いて、ガラス基板上に 均一な透明な導電性薄膜を形成でき、しかも、一般に使 用されるシリコンアルコキジドを含むコーティング液に 対するなじみがよいため、表面にオーバーコートを施し 30 【図1】AcAclnとAcAcSnとの添加量と、膜 て、低反射で機械的強度に優れた透明導電膜を形成で き、CRTなどの電界シールド、静電防止に優れた効果 が得られる。

【0051】また、本発明において、特筆すべきは、塗 布波中のAcAcIn | 又は、OctIn | とAcAc Sn [又は、OetSn] との総量が5重量%であると きに、低抵抗で亀裂やはじきの不都合のない導電膜が得 られたととである。したがって、成分配合量を特定する ことにより、粘性剤の添加が不要となり、極めて粘度の 低い、したがって、スピンコートによる展延性に優れた 透明導電膜を形成するととが可能である。

【図面の簡単な説明】

の表面抵抗値との関係を示す図である。

【図2】OctInとOctSnとの添加量と、膜の表 面抵抗値との関係を示す図である。



フロントページの続き

(72)発明者 小泉 啓寿 東京都品川区西五反田7 [1目9番4号 東 北化工株式会社内